# 走査型オージェ電子分光分析装置 PHI680S



# 操作マニュアル(基本編)

### 大阪大学接合科学研究所技術部

Ver.1.5

目次

| 使用上の注意点 |    | ••• | •  | • | • | •  | • | • | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3   |
|---------|----|-----|----|---|---|----|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| アイソレーショ | ンノ | เ้า | ィブ | に | つ | L١ | τ |   | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 4   |
| 試料について  | •  | ••• | •  | • | • | •  | • | • | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 7   |
| 非常時の対応  | •  | ••• | •  | • | • | •  | • | • | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 7   |
| 通常起動・・  | •  | ••• | •  | • | • | •  | • | • | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 8   |
| Vacuum  | Wä | a t | С  | h | e | r  | に | つ | L١ | τ |   | • | • | • | • | • | • | • | • | 10  |
| 試料導入 ・・ | •  | ••• | •  | • | • | •  | • | • | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 1 |
| SEM像の観察 |    | ••• | •  | • | • | •  | • | • | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14  |
| SEMメニュー |    | ••• | •  | • | • | •  | • | • | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15  |
| SERVEY  |    | ••• | •  | • | • | •  | • | • | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17  |
| イオンガン起動 |    | ••• | •  | • | • | •  | • | • | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19  |
| イオンガン停止 |    | ••• | •  | • | • | •  | • | • | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20  |
| その他分析の流 | れ  | •   | •  | • | • | •  | • | • | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21  |
| 通常停止・・  | •  | ••  | •  | • | • | •  | • | • | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22  |

### 【使用上の注意点】

この装置はあらかじめ利用申請し、使用許可を得なくては使用できません。 申請されていない方は、E-mailで申請願います。

この装置の使用は、SEM(走査型電子顕微鏡)の使用経験がある方に限らせていただき ます。

試料ホルダ、取扱説明書類、ソフトウェアなどは、絶対に無断で室外に持ち出さないでく ださい。

装置の維持・管理には最善を尽くしておりますが、状態により、使用条件等を制限することもあります、その場合、装置に条件等を掲示いたしますので、必ずお守りください。

コンピュータの画面のウインドウのタイトルは、"PC-ACCESS"や、"Vacuum Watcher" のように表し、ボタン等のキャプションは、[PUMP INTRO]のように表しています。コンピュ ータ画面上での操作は、DETECTER SED のように表しています。

また、スイッチの操作やバルブの操作などは、電源 ONや、アイソレーションバルブ CLOSE のように表しています。

"PC-ACCESS"ウインドウ上での操作は、通常の Windows とユーザーインターフェイスが 異なりますので、その操作が若干異なり、マウスの**左クリックで選択**し、**右クリックで決定** 

測定データを保存するディレクトリ(フォルダ)は、

| エネルギー制御学分野         | dpt1 |
|--------------------|------|
| エネルギー変換機構学分野       | dpt2 |
| エネルギープロセス学分野       | dpt3 |
| 溶接機構学分野            | dpt4 |
| 化学・生物接合機構学分野       | dpt5 |
| 複合化機構学分野           | dpt6 |
| 数理解析学分野            | dpt7 |
| 信頼性設計学分野           | dpt8 |
| 機能性診断学分野           | dpt9 |
| ナノ・マイクロ構造制御プロセス学分野 | spc1 |
| スマートビームプロセス学分野     | spc2 |
| スマートグリーンプロセス学分野    | spc3 |
| 信頼性評価・予測システム学分野    | spc4 |
| スマートコーティングプロセス学分野  | spc6 |
| 金属ガラス・無機材料接合技術開発拠点 | prj1 |
| 技術部                | tecd |

またこれらのディレクトリはあくまでも一時保存用ですので、メンテナンス等で、消去する可 能性があります、したがいまして、データは使用者各自の CD-R/RW に保存してお持ち帰りくだ さい。(画像データが無ければフロッピーディスクでも十分保存できます)。

### 【アイソレーションバルブについて】

アイソレーションバルブを閉めることにより、チャンバーの真空度が極端に悪くなった場合 もアナライザー側の真空を保ち、FEを保護することができます。FE が立ち上がっている状態 で、アナライザー側の真空が落ちるとチップが壊れる可能性が大きいです。したがって以下の 作業をおこなうときはアイソレーションバルブを閉じてからおこなってください。なお、アイ ソレーションバルブの開閉は、電子銃の Beam Voltage が完全に0V になってからおこなって ください。また、アイソレーションバルブを閉じるときは、時計方向に回して、少し回す感覚 が変化したように感じられるところ(少し軽く感じられます)で止めてください、閉めすぎる とバルブの寿命が短くなります。空けるときは、反時計方向に止まるところまで回してください。

- ・装置を使用しない時。(当然、終了時も)
- ・イントロ ステージ間のサンプルホルダーの受け渡し時。(V1バ ルブを開けるとき)
- ・試料の破断を行うとき。
- ・イオンガン使用のための、Ar ガス導入時。
- ・停電等、異常時。
- ・その他、チャンバーの真空度が、極端に悪くなると予想されるとき。

### 【試料について】

試料の作成法は、EPMA や SEM-EDX と同様に考えてください。超高真空装置ですから、 素手で取り扱ったり、油脂や、水分が付着したものは洗浄しなければなりません。

**粉末試料**(極力避けてください)や他孔質試料、その他ガスが出そうな試料の場合は、イントロで十分排気した後、測定チャンバーに導入し、さらに十分に真空排気してから測定してください。また、導電性テープや導電ペーストはできるだけ使用しないでください。やむ終えなく使用された場合は、真空度が悪くなり、使用可能になるまで時間を要することがありますので、使用前日に試料を導入し、翌日測定してください。

真空度が悪くなると(10<sup>-9</sup>torr以下)FEが**自動的に停止**し、再起動まで時間を要します。試料のホルダへの取り付け等については、次の表や図を参考にしてください。



| 取                       | 0付け方法   | 対象試料  | 利点・特徴   | 欠点・注意点  |
|-------------------------|---|---|---|---|
| ネジ止め法<br>ピン止め法<br>パネ止め法 | ・ネジ・ピン・パネで<br>押さえつける  | <ul> <li>・板状試料</li> <li>・ウェハ</li> <li>・不定形試料</li> </ul>   | ・固定が容易<br>・汚染が少ない                             | ・微小試料には不向き  |
| 粘着法                     | ・In, Pb などの柔ら<br>かい金属に押しつ<br>けて固定する   | <ul> <li>・微小試料</li> <li>・粉末試料</li> </ul>                  | <ul> <li>・固定が容易</li> <li>・試料汚染が少ない</li> </ul> | <ul> <li>・試料の飛散</li> <li>・金属からの情報</li> </ul>                                  |
|                         | <ul> <li>         ・         ・         導         電         性         両         面         テ         ー         プ         </li> <li>         で         固 定 する     </li> </ul> | <ul> <li>・微小試料</li> <li>・不定形の試料</li> <li>・線状試料</li> </ul> | ・固定が容易<br>・形状の制限がない                           | <ul> <li>粘着材からの汚染の</li> <li>影響</li> </ul>                                     |
|                         | ・Ag ペーストで固<br>定する   | ・不定形の試料<br>・微小試料  | ・固定が容易<br>・形状の制限がない                           | ・粘着材/溶媒からの汚<br>染の影響   |
| 詰め込み法                   | ・小さな穴の空いた<br>板や試料ホルダー<br>に試料を詰める  | ・粉末試料   | ・試料汚染が少ない                                     | ・試料の飛散  |
| 網止め法                    | • Ni メッシュな ど<br>電気伝導性網で<br>覆って固定する  | ・絶縁性試料  | ・チャージアップの<br>軽減                               | <ul> <li>網の陰によりスパッ<br/>タリングできないことがある</li> <li>スパッタリングによるメッシュ成分の再付着</li> </ul> |
| 包み込み法                   | <ul> <li>Al 箔など電気伝<br/>導性フィルムで包<br/>み込んで固定する</li> </ul>   | ・絶縁性試料  | ・チャージアップの<br>軽減                               | <ul> <li>・試料に損傷を与える</li> <li>可能性あり</li> </ul>                                 |

代表的な試料の取り付け方

\*粘着法はお勧めいたしません。

\*特別な場合以外は、金属マスク(押さえ板)を使った、ねじ止め法で固定してください。

### 各種試料ホルダ、取り付け例

(掲載されているホルダがすべてあるわけではありません、備え付けてないもので、必要なものがあればご相談に応じますのでお申し出ください、またホルダ等は絶対に持ち帰らないで ください。)



(a) 板状試料用ホルダー,(b) 板状試料用ホルダー,(c) 板状試料用ホルダー,(d) 表 面が傾斜した板状試料用ホルダー,(e) 表面が傾斜した板状試料用ホルダー,(f) 他試料 取り付けホルダー,(g) 塊状試料用ホルダー,(h) 断面分析用ホルダー,(i) 断面分析用 ホルダー,(j) 板状試料の取り付け,(k) 押え板を用いた粉末試料の取り付け,(l) 塊状 試料の取り付け,(m) 塊状試料の取り付け,(n) 断面分析試料の取り付け,(o) 断面分 析試料の取り付け,(p) 線状試料の取り付け

### 【非常時の対応】

装置から煙や炎が出た場合など身体、生命に危険を感じた場合は、すぐに、EMO-BOX の非常 停止スイッチを押してください。

その後、アイソレーションバルブを閉じてください。 地震、落雷その他の原因による、**停電**の場合は、アイソレーションバルブを閉じてください。

どちらの場合でも、速やかに報告してください。





ステージ動作中に暴走した場合には、EMO-BOX の非常停止スイッチは押 さないで、

"Stage Control"ウィンドウの STOP ボタンをクリックしてください。



【通常起動】

コンピュータ・ディスプレイの電源 ON。
 通常はディスプレイにこのような画面が出ている
 はずです。もし、全く違う画面が出ていたら、管理
 者に連絡してください。



#### 2、真空度確認。

左 電子銃(FE)の真空度、右 測 定チャンバーの真空度、大きく違っ ていたら、その後の操作は絶対にお こなわないで管理者に連絡してくだ さい。



OFF.

3、電子ビーム電源 (18-195)、Beam Volt



4、EMO-BOX、Electorical Power(右下の左側の白いス チ) *PUSH ON*。

右下の左側の白いスイッチ。大きな丸のスイッチは、 非常停止スイッチなので、誤って押さないように注意。 他のスイッチにも手を触れないでください。



イッ



5、PC上の"PC-ACCESS"起動。



プリンタの設定画面 [OK]クリック。

"PC-ACCESS"が起動して、次の画面が出たら [**OK**] クリック。

| 📲 Physical Ele | ctronics PC-ACCESS SAM V7.3D |
|----------------|------------------------------|
| OK             |                              |
| 6166           |                              |
|                |                              |

5、アイソレーションバルブ *CLOSE。* ノブをゆっくり回して、バルブが しまったところで、クリック感が あるので、それ以上回さないように注意してください。



6、BAIAS BOX のスイッチを *GND* から *Auto / +90* にする。



### 【Vacuum Watcherについて】

真空系の機器の操作や状態はこのプログラム上で実行・表示されます。



#### コマンドボタンの機能

- ・Pump Intro・・イントロを排気する、(蓋を押さえてください)。
- ・Backfill Intro・・イントロを大気圧にする、(窒素ガスでリーク、コンベクトロンで確認)。
- ・Transfer Sample・・サンプル移動のためにV1が開きます。
- Diff Pump ION Gun-ON・・差動排気をする、(イオンガン起動前に忘れないように、V3 が閉じて、V4が開きます)。
- Diff Pump ION Gun-OFF・・差動排気をやめる、(V4 が閉じます、イオンガン停止後 10 分以上経ってから、V4 が閉じます)。

・Turbo Pump-ON、Turbo Pum-OFF・・それぞれターボポンプをONまたは、OFFします。 それぞれの機能の実行後、実行状況はボタンの下のテキストボックスに表示されます。

Task XXXX complete と表示されたら実行終了です、これを確認してから次の操作に移ってください。

【試料導入】

外部 イントロ

1、窒素ガスボンベ、レギュレータ OPEN。 2、"Vacuum Watcher"の[BACKFILL INTRO]をク リック イントロが窒素でパージされます。 3、イントロ・コンベクトロンで大気圧になったこ とを確認してください。 4、イントロの蓋を取り、試料を素早くフォークに

装着してください。(取り外し、装填)。 5、窒素ガスボンベ、レギュレータ *CLOSE*。 
 Pump Intro
 Backfill Intro

 Transfer Sample
 Diff Pump Ion Gun - ON

 Diff Pump Ion Gun - ON
 Diff Pump Ion Gun - OFF

 Turbo Pump -ON
 Turbo Pump - OFF

Vacuum Tasks

6、イントロの蓋を軽く抑えながら(きっちり真空引きできるように)、"Vacuum Watcher" の[PUMP INTRO]をクリックしてください。

7、イントロが真空引きされるのを待つ。"Vacuum Watcher"上で確認。

#### Intro Sample:イントロ ステージ

1、アイソレーションバルブ CLOSE、確認

2、"Stage Control"の"Positions"で[INTRO SAMPLE]を選択、[DRIVE]をクリック、[OK]のウィンドウが開くが、まだ[OK]はクリックしないでください。
 3、"Vacuum Watcher"の[TRANSFER SAMPLE]をクリック、(V1 が開く)。
 4、トランスファーロッドを押し込んで、試料をフォークからステージに移す、
 位置に問題が無いことを確認。(ロッドはフラットな面が上)
 5、[OK]をクリック、(ステージが動く、完全に動作が止まるまで待つ、Stage

Control上で確認)。

6、トランスファーロッドを引き抜く(V1は自動的に閉じる)。

7、測定チャンバーの真空度が 2×10<sup>-9</sup>より良いのを確認して、アイソレーショ ンバルブ **OPEN**。



#### 注意!

最近、上記手順3で、[TRANSFER SAMPLE]をクリックした際に、完全にV1が開かなくて、再び閉じてしまうことが時々発生しています(現在のところ原因は不明です)。

[TRANSFER SAMPLE]をクリックした後にすぐにトランスファーロッドを押し 込まないで、"Vacuum Watcher"のウインドウがポップアップ表示されるのを待っ てから、押し込んでください。

もし、不完全オープンが発生し、V1 が閉じた場合("Vacuum Watcher"の状態ウ インドウに異常が表示されます)、再度、[TRANSFER SAMPLE]をクリックして ください。 1、"Stage Control"の"Positions"で**[PARK SAMPLE]**を選択、**[DRIVE]**をクリック、**[OK]**のウィンドウが開くが、まだ**[OK]**はクリックしないでください。

2、パーキング・アタッチメントの前後移動ダイアル(下のほう)を回転させて、1段前進(回転可能位置に移動さす)。

3、試料をパークする位置に、回転ダイアル(上のほう) を回転する、このとき必ずクリック位置で止めてください。 4、パーキング・アタッチメント前後移動ダイアルで試料 ホルダーにフォークを差し込む。(位置を確認しながら) 5、[OK]をクリック、(ステージが動く、完全に動作が止 まるまで待つ、Stage Control 上で確認)。



6、パーキング・アタッチメント前後移動ダイアルを回転させて、パーキング・アタッチメント

<sup>8000</sup>\_Z 10を入力する

を一段後退。パーク位置(一番奥)まで後退(戻す)。

7、"Stage Control"で Z 軸を 10mm に移動する、 (ステージが上昇する)。

8、パーキング・アタッチメント前後移動ハンドルを回転させて、パーキング・アタッチメント を前進させて試料ホルダに軽く当て、確実に試料がフォークに差し込まれたのを確認してくだ さい。

9、パーキング・アタッチメント前後移動ハンドルを回転させて、パーキング・アタッチメント をパーク位置(一番奥)まで後退(戻す)。

#### Retrieve Sample:パーキング・アタッチメント ステージ

1、"Stage Control<sup>"</sup>の"Positions"で[**Retrieve Sample**]を選択、[**DRIVE**]をクリック、[**OK**]のウィンドウが開きますが、まだ[**OK**]はクリックしないように注意してください。

2、パーキング・アタッチメントの前後移動ダイアル(下のほう)を回転させて、1段前進(回転の能位置に移動さす)。

3、装着する試料が装着位置(手前)に来るように、回転ダイアル(上のほう)を回転する、このとき必ずクリック位置で止めます。

4、パーキング・アタッチメント前後移動ダイアルを回して、試料を手前まで前進させます。

5、[OK]をクリック、(ステージが動く、完全に動作が止まるまで待つ、"Stage Control"上で 確認)。

6、パーキング・アタッチメント前後移動ダイアルを回して、試料を手前まで後退させ、フォークを試料から抜きます。(位置を確認しながら)

7、パーキング・アタッチメント前後移動ダイアルを回転させて、パーキング・アタッチメント をパーク位置(一番奥)まで後退(戻す)。

#### Extract Sample:ステージ イントロ

1、アイソレーションバルブ CLOSE、確認。

2、"Stage Control"の"Positions"で**[Extract Sample]**を選択、 **[DRIVE]**をクリック、**[OK]**のウィンドウが開くが、まだ[OK]は クリックしない。

3、"Vacuum Watcher"の**[TRANSFER SAMPLE]**をクリック、 (V1 が開く)。

4、トランスファーロッドのフォークを試料に差し込む、位置に 問題があるときは、**無理に差し込まないでください**。



4、[OK]をクリック、(ステージが動く、完全に動作が止まるまで待つ、"Stage Control"上で 確認)。

5、トランスファーロッドを引き抜く(V1は自動的に閉じる)。

6、測定チャンバーの真空度が2×10%より良いのを確認して、アイソレーションバルブ OPEN。

#### イントロ 外部(外部 イントロと同じ)

- 1、窒素ガスボンベ、レギュレータ OPEN。
- 2、"Vacuum Watcher"の[BACKFILL INTRO]をクリック イントロが窒素でパージされる。
- 3、イントロ・コンベクトロンで大気圧になったことを確認してください。
- 4、イントロの蓋を取り、試料を素早くフォークに装着する。(取り外し、装填)。
- 5、窒素ガスボンベ、レギュレータ CLOSE。

6、イントロの蓋を軽く抑えながら(きっちり真空引きできるように)、"Vacuum Watcher" の[PUMP INTRO]をクリックする。

7、イントロが真空引きされるのを待つ。"Vacuum Watcher"上で確認する。

### 【SEM像の観察】

- 1、測定チャンバーの真空度が 2×10<sup>-9</sup>より良いのを確認して、アイソレーションバルブ *OPEN*。
- 2、電子ビーム電源(18-195)、Beam Volt **ON**確認。

3、"PC-ACCESS"、**[HARD WARE]**選択、**[SEM]**選択。 4、"Stage Contlor"、**[CENTER]**を選択、**[DRIVE]**をク リック。ただし、試料がかなり分厚い(5mm くらい) ときは、試料の厚みを考慮してマニュアルで設定します。

| <b>HS Physical Electr</b> | onics PC-ACCES  | IS SAM V73D      | Tue Oct 8 15:32 |
|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Bardware                  | Sample<br>Setup | Setup<br>Acquire | Acquire         |
| SEM                       |                 | f1               |                 |
| Manual 2                  | Align           | £2               |                 |

5、**[SEM Page1]**、 Settings **[Zalign]** 選択、Beam **ON**。

| - The second | stical Dectorics PC-ACCESS SAM V730 | Tue Oct 8 161 | 3 2002         | NEWSTON   |                     | 1010          |               | X     |
|--------------|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------|---------------------|---------------|---------------|-------|
| A<br>Vi      | uto<br>deo                          | Photo         | Photo<br>setup | Settin    | g Read<br>ys Beam I | SEM<br>Page 3 | SEM<br>Page 2 | Exit  |
|              |                                     | Scan          | ning Ele       | ctron Mic | roscope #1          |               |               |       |
| a            | Settings Previous SA                | ign 31        | le 1           | OkV10nA 1 | OkVinA 10           | kVmaxI 12k    | V15nA Next    |       |
| b            | Magnification 1                     | 250 c         | Magnific       | ation 2   | 1000                | Present Ma    | gnification   | 1 = 1 |
| d            | Focus                               |               | 66.600         |           |                     |               |               |       |
| e            | Stigmation                          | X=            | -30.0          | 1 Y= 1    | 10.0                |               |               |       |
| g            | Image Shift                         | X=            | 0.00           | h Y=      | 0.00                |               |               |       |
| 1            | Image rotation (deg)                |               | 0              |           |                     |               |               |       |
| 1            | Gun Lens Voltage (kV)               |               | 0.157          |           |                     |               |               |       |
| k            | Extraction voltage (kV)             |               | 3.100          |           |                     |               |               |       |
| 1            | Beam                                |               | Dn             | Off       | Auto                |               |               |       |
| m            | Beam voltage (kV)                   | 2             | 1.000          |           |                     |               |               |       |
| n            | Scan rate                           |               | Fast           | Medium    | Slow                |               |               |       |
| 0            | Persistance                         |               | 1              |           |                     |               |               |       |
| p            | Reduced Image                       |               | Yes No         |           |                     |               |               |       |

6、 **[SEM Page2]**、 DETECTER **SED**。 SED MULTI PLIER **ON**。



7、試料電流を測定する。[SEM Page1]、[Read Beam I] クリック。KEITHLEY485 ピコアンメ ーターで読み取る。設定電流のおよそ 60~80%程 度流れていれば正常です。



8、高さを調節する、[EXIT]、[MANUAL Z ALIGMENT]、"Stage Control"の Z 軸を上下させて、ピーク位置が指定位置になるように調整する。調整後、[EXIT]、[HARDWARE]、[SEM]。 9、低倍率時、FOCUS で像がきっちり観察できるように調整、高倍率にしてさらに調整。 10、X3000~5000 で FOCUS STEERING で像の位置が移動しないように調整。 11、STIGMATION で像が流れないように調整、20-625、GUN CONTROL の FINE FOCUS

ダイアルでピントの微調整、これを繰り返して、ベストの状態にします。 12、[AUTO VIDEO]で明るさ、コントラストの自動調節ができます。

13、像を保存するときは、[PHOTO SETUP]でおこないます。

14、 **[PHOTO SETUP]**で、出力先(ファイル、プリンタ等)、出力内容を選択して、Image Output で出力します。

### 【SEMメニュー】

#### SEM PAGE 1

a,Setting b,Magnification d,Focus e,Stigmation g,Image Shift i,Image Rotation j,k, - 触らない。 l,Beam m,Beam Voltage h,Scan Rate o, - 触らない。 p,Reduced Image

#### **SEM PAGE 2**

a,b, - SEM PAGE 1 と同じ。 d,Detector e,SED Mutiplier f, - 触らない。 g,Contrast Control h,Brightness i,DC Offset j,k,l,m,n,o,p,q, - 触らない。

#### SEM PAGE 3

a,b,d,e,g, - SEM PAGE 1 と同じ。 i,j,k,l,m,n, - 触らない。 o,Focus Steering q, - 触らない。 r, - SEM PAGE 1 と同じ。 s,t,u, - 触らない。

## 【SERVEY】

様々な分析法で測定する前に、試料表面上にどのような元素が分布しているかを知るためにサ ーベイをおこなっておくと便利です。

1、[LOAD DISP]、[DIR]で測定データ保存先のディレクトリを、選択、または新しく作る。



2、**[SAMPLE SETUP]、[SAMPLE SETUP]**で必要ならば、試料名(ファイル名)、コメント 等を入力する。

| Physical Elect | ones PO-ACCESS SAM V750       | Tile Oct 0 154 | 1 2002          | والمراجع والمحافظ الأفري | -              | ويعتبد بالمراجع   |               | ×            |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|
| Bardware       | Sample Setup<br>Setup Sequire | Acquire        | Load<br>Display | List<br>Parms            | Auto<br>mation | System<br>Control | PE/HCP<br>MCD | NEXT<br>BANK |
|                | Sample Setup                  | fl             |                 |                          |                |                   |               |              |
| 1              | Area Define                   | £2             |                 |                          |                |                   |               |              |
|                | Area Select                   | £3             |                 |                          |                |                   |               |              |
|                | Reg Image Setup               | 24             |                 |                          |                |                   |               |              |
|                | Register Image                | £5             |                 |                          |                |                   |               |              |
|                | Line Define                   | 16             |                 |                          |                |                   |               |              |
|                | Line Select                   | £7             |                 |                          |                |                   |               |              |
|                | Zalar Setup                   | f8             |                 |                          |                |                   |               |              |
|                | Dir                           | £9             |                 |                          |                |                   |               |              |

3、**[SETUP ACQUIRE]**、**[SETUP SERVEY]**で測定条件を設定する。Full 観察野全域をサ ーベイする、Point **[SAMPLE SETUP]**の**[AREA DEFINE]**で指定した点をサーベイする。

| Physical Electron | ones PO-ACCES   | IS SAM V730 The Oct. I | 1542 2002         |               |                |                   |               |              |
|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|
| Bardware          | Sample<br>Setup | Acquir                 | e Load<br>Display | List<br>Parms | Auto<br>mation | System<br>Control | PE/MCP<br>MCD | NEXT<br>BANK |
|                   |                 | Setup Survey           | fl                |               |                |                   |               |              |
|                   |                 | Setup Mult             | £2                |               |                |                   |               |              |
|                   |                 | Setup Profile          | £3                |               |                |                   |               |              |
|                   |                 | Setup Line             | 14                |               |                |                   |               |              |
|                   |                 |                        |                   |               |                |                   |               |              |
|                   |                 | Setup Map              | £5                |               |                |                   |               |              |
|                   |                 | Setup More             | £6                |               |                |                   |               |              |
|                   |                 | Resume Acquire         | 17                |               |                |                   |               |              |
|                   |                 | Change Profile         | 18                |               |                |                   |               |              |
|                   |                 |                        |                   |               |                |                   |               |              |
|                   |                 | Acq. Display           | £9                |               |                |                   |               |              |

4、[ACQUIRE]、[ACQUIRE SERVEY]でサーベイ開始。

| Physical Factor | mic: PO-AGOES   | S SAM VISD       | Tim Oct #10          | 542 2002        |    |               |                |                   |               | ×            |
|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|----|---------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|
| Bardware        | Sample<br>Setup | Setup<br>Acquire | in the second second | Load<br>Display |    | List<br>Parms | Auto<br>mation | System<br>Control | FE/MCP<br>MCD | NEXT<br>BANK |
|                 |                 |                  | Acquire              | Survey          | f1 |               |                |                   |               |              |
|                 |                 |                  | Acquire              | Mult            | £2 |               |                |                   |               |              |
|                 |                 |                  | Acquire              | Profile         | 13 |               |                |                   |               |              |
|                 |                 |                  | Acquire              | Line            | £4 |               |                |                   |               |              |
|                 |                 |                  | Acquire              | Мар             | 15 |               |                |                   |               |              |
|                 |                 |                  | Acquire              | More            | £6 |               |                |                   |               |              |
|                 |                 |                  | Resume J             | Acquire         | 17 |               |                |                   |               |              |
|                 |                 |                  | Foregrou             | und             | £8 |               |                |                   |               |              |
|                 |                 |                  | Acq. Di              | splay           | 19 |               |                |                   |               |              |

#### 19

### 【イオンガン起動】

1, **[HARDWARE] [SEM]**, BEAM **OFF**, SED MULTIPLIER **OFF**.

2、アイソレーションバルブ *CLOSE*(サーモバル ブを手動で開くときのみ必要)。

3、"Vacuum Watcher"、**[DIFF PUMP IONGUN ON]** クリック、(V3 CLOSE、V4 OPEN、イ ントロの排気が停止し、イオンガンが排気される、 差動排気をおこなう)。

4、"Iongun Control"、[VIEW]、[SHORT]のチェックをはずす。 5、スタンバイ条件の設定。

6、[GUN STATE] [STAND BY]にチェックする、Ionnizer に 通電する、この状態でないと、**ガスは出ません**。

7、[VIEW] [EXTRACT PRESSER]でガス圧を表示させます。



C Standby

Off

**Backfill Intro** 

Diff Pump Ion Gun - OFF

🔲 Enable Time

Time (min): 0.2



Vacuum Tasks

Pump Intro

Transfer Sample

Diff Pump Ion Gun - ON

8、サーモバルブ手動調節ノブをゆっ くりと開き、アルゴンガス圧、30~ 40mPa にする、サーモバルブは、お よそ 1 回転したところから開き始め る、表示の反応はかなり遅く、ガスは 出始めると急速に増加することがあ るので注意してください。

9、RVG050G(サーモバルブコント ローラ)の電源スイッチ **ON**、上の

セットスイッチを **SETPOINT**、(LIMIT ではバルブが閉じる)。 10、SETPOINT の設定目盛は1目盛で 5mPa、通常3目盛(15mPa)。

- 11、ガス圧が15mPaに落ち着いたら、アイソレーションバルブ OPEN。
- 12、 [HARDWARE] [SEM]、 BEAM ON。

13、イオンガンの照射を停止したときは、セットスイッチを SETPOINT LIMIT にする。 14、試料の交換等で、イントロを真空引きする時は、差動排気を停止しなければならないので、 イオンガンを停止する。[GUN STATE] [OFF]にチェックしてください。

### 【イオンガン停止】

1、電子ビームが出ていないことを確認して、**アイ** ソレーションバルブを閉じる。

2、イオンガンを停止させてから 10~20 分経った ら、"Vacuum Watcher"の[**DIFFPUMP IONGUN OFF]**(差動排気停止)をクリック。(V4 CLOSE、 イオンガンの排気が停止し、イントロが排気され る)。万が一、真空度が 10<sup>-9</sup>より悪くなってしまっ たら、再び差動排気を開始します。

| Pumpintro              | Backfill Intro          |
|------------------------|-------------------------|
| Transfer Sample        |                         |
|                        |                         |
| Diff Pump Ion Gun - ON | Diff Pump Ion Gun - OFF |

3、RVG050G(サーモバルブコントローラ)の電源スイッチ OFF、上のセットスイッチは LIMIT で、バルブが閉じているはずであるが、もし SETPOINT になっているときは、LIMIT にする。

4、サーモバルブが冷えてくると、バルブは開き始めるので、手動調節ノブを少しずつ閉めます。





5、"Vacuum Watcher"の**[PUMP INTRO]**をクリックする。(V3 OPEN、イントロが排気される)。

#### 注意!

最近、イオンガン停止時の操作ミスによる、トラブル(チャンバーの真空が急激に 悪化し、FE、イオンポンプが停止する)が続けて発生しました。装置に多大なダ メージを与える恐れがありますので、上記の手順、および下記の注意を必ず守って ください。

RVG050G(サーモバルブコントローラ)の電源スイッチを OFF にすると、はじめは 何も変化がありませんが、時間がたち、冷えてくるとバルブが開いた状態となり、 そのまま放置すると、多量のガスがチャンバー内に流入し、真空が悪くなります。 真空計から目を離さず、真空度が悪くなってきたら、それに応じてバルブを時計回 りに少しずつ閉め、真空度が悪くならなくなったら、最後まで閉めてください。

### 【その他分析の流れ】

この装置では、試料表面上に存在する元素を広いエネルギー範囲で素早く判定するサーベイの ほかに、

・指定した複数の元素について、狭いエネルギー範囲で、高分解能測定ができる、マルチプレックス測定(Multi)。

・イオンガンを用いてスパッタリングしながら測定する、深さ方向の分析(Profile)。

・指定したラインに沿って、複数の元素の分布情報を得る、線分析(Line)。

・2次元表面上の、複数の元素の分布情報を得る、面分析(Map)。

が可能です。

それぞれの分析の流れは、まず、[SETUP ACQUIRE] で分析法を選択し(SETUP XXXX) 測定条件などを入力した後、[ACQUIRE]で測定を開始し、データ解析は MultiPack という ソフトウエアでおこないます。詳しくは Model680 操作マニュアル、もしくは簡易操作マニュ アル(分析・応用編)を参照してください。

### 【通常停止】

BAIAS BOX のスイッチを Auto / +90 から GND にする。
 アイソレーションバルブ *CLOSE*。



2、"PC-ACCESS"、[SYSTEM CONTROL]選択、[EXIT ROGRAM]選択。



3、[YES]をクリック。

4、EMO-BOX、Electorical Power **PUSH OFF**。 下段の左側の白いスイッチです。



5、コンピュータ・ディスプレイの電源 ONF にしてください。

#### 6、使用記録簿を必ず記入してください。

7、持ってきたものは、忘れずに**全てお持ち帰り願います**、また基本的持ち込んだ試料も、取り 外して、持ち帰ってもらいますが、翌日に続きの測定をするなどの理由でで、チャンバ内(パ ーキングアタッチメント上も含めて)や、デシケータ内に残しておく場合は、使用記録簿にそ の都度を記入してください。もしなにも記入していない場合、メンテナンス等で処分する場合 があります。